

Excimer Laser를 이용한 Atom Probe Field Ion Microscope

송 순 달
산업과학기술연구소

표면에서 일어나는 현상을 원자분해능으로 연구하기 위해, TOF-MS와 FIM을 제작하고 지금까지 사용해온 측정방법과는 완전히 다른 새로운 측정 기술을 개발하여 Excimer Laser로써 연구하는 방법소개와 이 새로운 방법의 정확성 그리고 NO 기스와 텅스텐 표면에서의 실험결과를 소개한다.